⑩ 日本国特許庁(JP)

平1-98723 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

 Int Cl ⁴ F 16 F 15/02 識別記号 广内整理番号 43公開 平成1年(1989)4月17日

の出 願 人

6581 - 3J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

アクティブ防振制御方法 9発明の名称

> 印特 頭 昭62-253547

願 昭62(1987)10月9日 29出

70発 明 \blacksquare 雄二 老

岡山県岡山市築港ひかり町9-25 東京都中央区築地5丁目6番4号

外2名 の代 理 人 弁理士 小川 信一

三井造船株式会社

明 和

1. 発明の名称

アクティブ防振制御方法

2. 特許請求の範囲

複数個のアクチュエータからなる変位発生部 と複数個の力検出器からなるセンサ部とを積層 して支持装置とし、該支持装置に負荷されるモ ーメントあるいは軸力に対応する信号をセンサ 部から取り出し、各信号ごとに最適なゲイン調 整と時間に関する一階積分を含む演算を加えて 得られる各信号に基づいて支持装置のたわみ角 あるいは軸変位を個別にあるいは同時に制御す るように変位発生部の各アクチュエータを駆動 することを特徴とするアクティブ防張制御方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はアクティブ防振制御方法、より詳し くは例えば曲げあるいはねじり振動をする片持 梁などの防振として好適なアクティブ防振制御 方法に関するものである。

〔従来技術〕

梁などの構造体に外乱が作用すると固有振動 が生じる。このとき、構造体の減衰が大きいほ ど変位振幅は小さく、パルス状の外乱に対して は振動の継続時間も短かくなる。しかるに、排 **造体の減衰能力には限界があるため、アクチェ** エータを用いて能動的に減衰特性を改善する方 法が考えられるようになってきた。

例えばロボットアームではアームの先端に加 速度検出器を取付け、そこから得られる速度信 号に基づいてアーム根元部のアクチュエータを 駆動する方法が提案されている。

しかしながら、すでに提案されている方法は いずれも物体の振動変位、速度、加速度を検出 するもので、アクチュエータと振動検出器を別 々に取付ける必要があり、装置が複雑化すると いう問題があった。

かかることから、本発明者は直列に配置した アクチュエータと力検出器からなる支持装置を 用い、力検出器の信号に基づきアクチュエータ を駆動する防振制御方法を発明し、先に提案し *

即ち、第8図及び第9図に示されるように、振動体1をジルコン、チタン酸鉛等の圧電素子ディスクで形成された圧電アクチュエータ4と同様というで形成された圧電アクチュエータ4と同間であた力検出器5(センサ部)かそそでで、圧電体によるででであります。 にはまり は に 世 素子ディスクにより 構成されている。

そして力検出器 5 によって検出される振動体 1 の変動荷重を出力電圧 V 、として取出し、これを演算部 6 に導きこれを感度調節し、一階の積分器10を通した後、加算器11で圧電アクチュエータ 4 が必要とするバイアス電圧を加えて電圧信号 V とし、これを増幅器 7 で増幅して印加電圧 V 。とし、この信号により圧電アクチュエータ 4 を駆動するようにしたものである。

(発明の概要)

(実施例-1)

以下、第1図ないし第3図に基づき本発明に よるアクティブ防振制御方法の第1の実施例を 説明する。

第1図は中ぐり加工用の切削工具の平面図、 第2図はその斜視図である。

切削工具21はホルダ22の先端に支持装置23を

これにより、振動体 1 と支持台 2 の間に被窓作用が働き、振動エネルギが吸収される。したかって、振動体 1 が共振するのを仰さえ、振動体 1 から支持台 2 に伝搬する力も抑制することができる。また、振動体 1 に加えられる起振力と振動体 1 の振動変位が干渉して生じる自励振動も、減衰作用により、その発生が抑えられる。

ところで、かかるアクティブ防張制御方法によれば、振動体1が矢印A-A方向に振動する場合は極めて有効なものであるが、例えばこの振動体1がB-B方向に回転する曲が振動が生じた場合、良好な支持装置として使用することができないと云う問題があった。

(発明の目的)

本発明は前記したような従来技術の問題点を解決するためになされたものであって、その目的とするところは、小型でかつ制御系が簡単な方式で直線方向及び曲げ方向の両方の振動を個別に、あるいは同時に制御するアクティブ防振方法を提供するものである。

これら圧電アクチュエータ24 a、24 b および 力検出器25 a、25 b はそれぞれホルダ22の中心 軸Cの両側にそれぞれの中心軸Cと平行になる ように離間して配置されている。そして力検出 器25 a、25 b の信号は、ライン26 a、26 b によ り制御装置27に導かれるとともに、圧電アクチュエータ24 a、24 b には制御装置27から後述す る印加電圧信号がライン28 a、28 b を介して与 えられるように構成されている。なお、29 A は 被加工物である。

前記構成の切削工具21において、被加工物29 A を切削する場合、その先端部に曲げ振動であ る「再生ビビリ振動」が工具チップ29を介して 矢印B-B方向に生じ、これが切削工具21にそ の中心軸でを中心とする変動曲げモーメントと して作用する。

この変動曲げモーメントが作用すると、これを力検出器25 a , 25 b により検知し、信号として出力電圧 V r r 、 V r z を制御装置27に導く。この制御装置27に導かれた出力電圧 V r r 、 V r z は、第3 図に示すようにそれぞれ感度調整されて減算器30に導かれ、ここで相対量が算出される。なお、この相対量は変動曲げモーメントの信号に対応する。

その相対量信号が積分器31に導かれ、ここで時間に関して一階積分が加えられ、電圧信号 V とされる。この電圧信号 V は支持装置23に被譲作用を働させるためのたわみ角の制御量である。そこで、圧電アクチュエータ 24 a を駆動するための電圧信号 V 、と他方の

圧電アクチュエータ24 b を駆動するための電圧信号 V z とに分けられ、この電圧信号 V z は反転器32で反転される。

そして電圧信号 V 1 及び V 2 は圧電アクチュエータ 24 a 24 b が必要とするバイアス電圧が加算器 33 34 により加えられ、増幅器 35 36 を通って印加電圧信号 V a 1 、 V a 2 となる。この印加電圧信号 V a 1 V a 2 がライン 28 a 28 b により圧電アクチュエータ 24 a 24 b に与えられると、この圧電アクチュエータ 24 a 24 b は大きさが同じで符号が互いに反対の変位が生じ、支持装置 23 の両端面間にたわみ 4 が 4 じる。

このたわみ角は、支持装置23を伝達する曲げモーメントに対して90°の位相遅れをもつことから、このたわみ角と支持装置23を伝達する曲げモーメントによって減衰作用が働き、曲げ振動エネルギが散逸し、再生ビビリ振動が制御されるのである。

前記実施例は、本発明を切削工具に適用した 場合について説明したが、例えば片持梁の曲げ

援動の防止手段としても適用可能である。

更に、圧電アクチュエータ24 a , 24 b および 力検出器25 a , 25 b はホルダ22の中心軸 C に対 して左右平行にそれぞれ各 1 個を配置したが、 本発明は無論これに限定されるものではなく、 必要に応じて複数個設けることができるもので あり、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更す ることができることは明らかである。

また、制御装置27の積分器31を減算器30の前段階にそれぞれ別個に挿入しても第3図と本質的に何ら相違ないことは明らかである。

〔実施例-2〕

次に、第4図ないし第7図に基づき木発明に よるアクティブ防振制御方法の第2の実施例を 説明する。

第4図は先端に質量40をもつ片持ちの帯板41の支持構成を示す図、第5図は支持装置の平断面図、第6図はその側断面図であり、そして第7図は帯板41の曲げ振動とねじり振動を同時に減衰させるための制御回路である。

質量40を支える帯板41は支持装置42を介してフレーム43に固定されている。前記フレーム43に外乱が入ると、この帯板41には第4図に示す方向の曲げ振動Mとねじり振動Tが顕著に現われる。これは帯板41の剛性がこれらの振動に対して弱いためである。

支持装置42は第5図及び第6図に示すように X・Y軸より離間して平行に配置された4つの 圧電アクチュエータ43 a , 43 b , 43 c , 43 d からなる変位発生部と、それらと同一軸上に配置された4つの力検出器44 a , 44 b , 44 c , 44 d からなるセンサ部を積層配置して構成している。

そして、前記変位発生部43 a ~ 43 d とセンサ 部44 a . 44 d を隔離するコア45が介挿され、前 記変位発生部の一面に上板46が、またセンサ部 の一面に下板47がそれぞれ設けられている。更 に、前記上板46とコア45と下板47とコア45はボ ルト48. 49で締結されて一体に組立てられている。

ここで、圧電アクチュエータ43aと力検出器

44 a 、同様に43 b と44 b , 43 c と44 c , 43 d と 44 d はそれぞれ同軸上になるように配置されて いる。

力検出器44a~44dの出力信号 Vra. Vrc. Vraは制御装置50に導かれるとともに、 圧電アクチュエータ43a~43dには制御装置50 から後述する印加電圧信号が与えられるように 機成されている。

いま、フレーム43が振動すると支持装置42に 振動力が作用する。これを力検出器44 a ~44 d により検知し、信号として出力電圧 V_{ra} , V_{rb} .

このとき、第5図に示すY-Y軸が第4図の帯板41の長手方向と一致するように支持装置42を配置したとすると、帯板41の曲げ振動Mにより支持装置42に加えられるモーメントは力検出器44aと44cの出力電圧V・とV・の平均値の差として検出でき、帯板41のねじり振動Tにより支持装置42に加えられるモーメントは

力検出器44 a と44 b の出力電圧 V raと V raの平均値と力検出器44 c と44 d の出力電圧 V raと V raの平均値の差として検出できる。

したがって、制御装置50では第7図に示すように出力電圧 Vra. Vra. Vra. Vraはそれぞれ感度調整されて平均値回路51に遅かれる。

そして、2組に分けられ滅算器52に入力され、出力電圧 V . および V . を得る。なお、前記出力電圧 V . および V . は曲げ振動 M に対するモーメントおよびねじり振動 T に対するモーメントに対応している。

この印加電圧信号 V a a 、 V a c 、 V a c 、 V a c が電圧アクチュエータ 43 a 、 43 b 、 43 c 、 43 d に与えられると、これらの圧電アクチュエータ 43 a ~ 43 d は個別に変位し、支持装置 42 の端に 2 方向のたわみ角が生じる。このたわみ角と支持装置 42 を伝達する各モーメントによって前記第1の実施例と同様にして減衰作用が働き、記第1の実施例と同様にして減衰作用が働き、が散逸し、フレーム 43の振動にともなう帯板 41 の曲 げおよびねじりの固有振動が抑制される。

前記実施例では4つの圧電アクチュエータと 4つの力検出器を用いたが、本発明は無論これ に限定されるものではなく、必要に応じて個数 および配置を変更することができる。

さらに、例えば4つの検出器の出力電圧の総和を用いた同様の制御回路を追加することにより支持装置の軸方向、つまり、X-X方向およびY-Y方向に垂直な方向の振動も同時に被衰させることができることは言うまでもない。

また、制御装置50の積分器53は制御回路中の

他の場所に移しても各信号が各1回積分器を通 る構成であれば本質的に何ら相違しないことは 明らかである。

前記実施例1及び実施例2ではともに、アクチュエータの数と力検出器の数を同数とし、それぞれ各1が同一軸上に配置されている。

しかしながら、本発明では少なくとも変位発生部を伝達する軸力、せん断力、曲げモーメントをセンサ部で検出できるように変位発生部とセンサ部が直列に配置されておれば十分であり、したがって変位発生部を構成するアクチュエータの数とセンサ部を構成する力検出器の数は必ずしも同数である必要はなく、また、個々のアクチュエータと力検出器を同一軸上に配置する必要がない。

ただし、この場合には実施例2に示すように、 変位発生部とセンサ部との間に剛体板が必要と なる。

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明によ

したがって、支持装置で支持された物体の定常振動時の共振応答倍率は散逸による減衰作用によって大幅に低下し、また、切削工具の再生ピビリ振動などに見られる自励振動も防止される。

さらに固有振動数の低い梁構造を支持装置を 介してフレームに固定すると、フレームが振動 しても、支持装置内のエネルギ散逸作用により、 振動エネルギが梁構造の固有振動エネルギに変換されるのを抑制することができる。また、変位発生部とセンサ部を一体化させることによりコンパクトな制振装置が実現できる。

さらにまた、支持装置を伝達する力およびモーメントを利用して振動エネルギを吸収することから、大きな制御力を必要としない。

4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第3図は本発明によるアクティフ防振制御方法の第1の実施例を示すものであって、第1図は中ぐり加工用切削工具の平面図、第2図はその斜視図、第3図は制御プロック図である。

第4図ないし第7図は第2の実施例を示すものであって、第4図は片持ち帯板支持構造の斜視図、第5図は前記支持支持構造に使用した支持装置の平面図、第6図はその断面図、第7図は制御プロック図である。

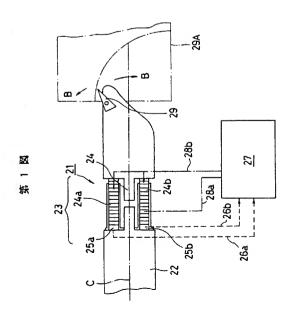
第8図及び第9図は従来のアクティブ防振制 御方法の説明図で、第8図は防振制御構成図、

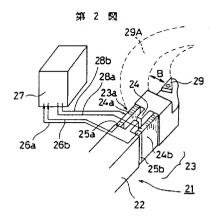
第9図はその演算ブロック図である。

1 …振動体、2 …支持台、3 …支持装置、4 …電圧アクチュエータ、5 …力検出器、6 …演算部、7 …増幅器、10…積分器、11 …加算器、21 …切削工具、22 …ホルダ、23 …支持装置、24 … 弾性ばね構造部、24 a ,24 b …圧電アクチュエータ、25 a ,25 b …力検出器、26 a ,26 b ,28 a ,28 b …ライン、27 …制御装置、29 …工具チップ、29 A …被加工物、30 … 波算器、31 …積分器、32 … 反転器、33、34 …加算器、40 …質量、41 …帯板、42 …支持装置、43 …フレーム、43 a ,43 d …圧電アクチュエータ、44 a ~44 d …力検出器、50 …制御装置、51 …平均値回路、52 … 波算器、53 … 積分器、54 …加波

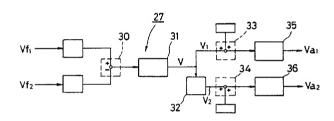
代理人 弁理士 小 川 信 一 弁理士 野 口 賢 照 弁理士 斎 下 和 彦

算器、55…加算器、56…增幅器。

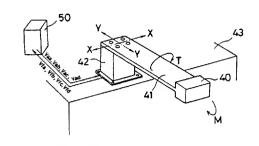


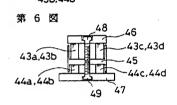


第 3 図

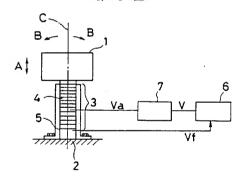


第 4 図

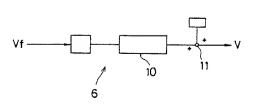




第 8 図



第 9 図



PAT-NO: JP401098723A

DOCUMENT- JP 01098723 A

IDENTIFIER:

TITLE: ACTIVE

VIBRATIONPROOFING

CONTROL METHOD

PUBN-DATE: April 17, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SUGITA, YUJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MITSUI ENG & SHIPBUILD CO LTD N/A

APPL-NO: JP62253547

APPL-DATE: October 9, 1987

INT-CL (IPC): F16F015/02

US-CL-CURRENT: 188/378

ABSTRACT:

PURPOSE: To control vibration in linear direction and bending direction separately or at the same time with a small-sized and still simple method in control system by making a supporting device through laminating displacement generating parts composed of plural numbers of actuators and sensor parts composed of plural numbers of force detectors.

CONSTITUTION: When a work piece 29A is cut with a cutting tool 21, variable bending moment having the center axis of the tool as the center acts to the cutting tool 21. This is detected with force detectors 25a, 25b and output voltages Vf1, Vf2 are led to a control unit 27. Output voltages Vf1,Vf2 are computed relative values and these are integrated one order about time by an integrator 31 and then the result is regarded as voltage signal V. This voltage signal V is controlled variable of deflection angle for the purpose of acting damping action to a supporting device 23. From the fact that this deflection angle has a phase delayed by 90° against bending moment transmitting in the supporting device 23, damping action is acted by the deflection angle and the bending moment transmitting in the supporting device 23, and

thereby bending vibration energy is scattered and lost.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio